先端研レクチャーシリーズ　第3回

超高真空技術

講師：　山川　紘一郎

（先端基礎研究センター　ナノスケールGr）

日時：令和元年１２月１３日（金）１３：３０～１５：００

場所：先端基礎研究交流棟
２階　ロビー

要旨

　超高真空下で表面研究を行なうには，その目的に最適化した超高真空装置を製作することが望まれます．本講義では，表面研究のための超高真空装置を製作，改良する上で必要な知識とノウハウを，実例に基づき丁寧に解説します．

1. 超高真空技術の基礎
2. 材料の選定
3. 真空ポンプと真空計
4. 超高真空装置製作技術
5. 試料まわり
6. 安全、環境保全、省エネルギー

連絡先：先端基礎研究センター　ナノスケールGr
山川紘一郎　(yamakawa.koichiro@jaea.go.jp)